

(様式 1)

## 表面分析士(認定・認定変更)申請書

下記のように、表面分析士認定(認定内容変更)の申請をいたします。

申請手続き費用: 認定時 3,000円+消費税  
変更時 1,000円+消費税

(事務局記入) 受付日: \_\_\_\_\_ 受付番号: \_\_\_\_\_

1. 氏 名 : \_\_\_\_\_ 印
2. 申請年月日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日
3. 所属機関 : \_\_\_\_\_
4. 所属部署 : \_\_\_\_\_
5. 連絡先(所属機関所在地または自宅住所のいずれか):  
〒 \_\_\_\_\_
6. 電話: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_
7. 電子メール: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

### 8. 申請技術分野一覧

※ 下の一覧を参照の上、[9. 認定要件まとめ]の表で申請したい技術名称を○で囲む。  
複数選択可。[5-3 SPM その他]を選択した場合は、申請を希望する SPM 関連技術名称を記入欄に記述する。

1. X線光電子分光法 (XPS: X-ray Photoelectron Spectroscopy)
2. オージェ電子分光法 (AES: Auger Electron Spectroscopy)
3. 二次イオン質量分析法 (SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry)
  - 3-1 D-SIMS: Dynamic SIMS
  - 3-2 TOF-SIMS: Time of Flight SIMS
4. 電子線マイクロアナリシス (EPMA: Electron Probe Microanalysis)
  - 4-1 WDX: Wavelength Dispersive X-ray Spectrometry (波長分散型分光法)
  - 4-2 EDX: Energy Dispersive X-ray Spectrometry (エネルギー分散型分光法)
5. 走査プローブ顕微鏡法 (SPM: Scanning Probe Microscopy)
  - 5-1 AFM: Atomic Force Microscopy (原子間力顕微鏡)
  - 5-2 STM: Scanning Tunneling Microscopy (走査トンネル顕微鏡)
  - 5-3 その他(申請を希望する SPM 関連技術名称を下の記入欄に記述)

記入欄 \_\_\_\_\_

(様式 1)

9. 認定要件まとめ:

※ 申請技術を○で囲み、該当する欄に件数等を記入する。

※ISO セミナーの受講、国内会議発表、国際会議発表、JSA 論文掲載は全申請技術を通して、各要件について1件以上を必須とするが、全ての技術に対して全要件が1件以上である必要はない。

※ 実務経験を客観的に示すための推薦書(提出は必須ではない)がある場合は、該当欄にチェックする。

申請技術		実務経験を客観的に示すための要件([ ] 内は SASJ 活動に関わる件数)				推薦状 (該当に チェック)
		学術誌(査読有のみ)への 論文掲載数 ([ ]内は JSA 誌の査読付き 記事掲載数)		学会発表件数 ([ ]内は SASJ 主催の国内会議(定例 研究会と国内 PSA)と国際会議(PSA と iSAS など)での発表件数)		
		英語	日本語	国内	国際	
XPS		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
AES		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
SIMS	D-SIMS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
	TOF-SIMS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
EPMA	WDX	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
	EDX	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
SPM	AFM	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
	STM	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	<input type="checkbox"/>
ISO セミナー受講年度						

認定委員会記入欄

年 月 日

	委員1	委員2	委員3	委員4	委員5	委員6	総合判定
可否							
署名							
否認の場合は改善すべき点を記載(委員名: )							

注: 印刷して記入署名後、FAX(03-3473-6862)か、スキャンファイルを標準化活動部会委員長宛に電子メールで送付下さい。

(様式 2)

## 実務経歴書（申請技術：\_\_\_\_\_）

※ 申請技術ごとに 1 ページ以内で作成すること。

※ 客観的な根拠資料となる論文や学会アブストのコピーを、付属資料として番号をつけて添付すること。  
付属資料の様式は問わない。

申請者氏名：\_\_\_\_\_

記入年月日：\_\_\_\_\_年 月 日

### 【具体的実務経歴】

※具体的実務の内容を 3 件程度記述。各々数行で記述すること。

例) ○○○○ - ○○○○ 年、△△△法による×××の分析に従事、付属資料番号[1, 2, 3... ]

1)

2)

3)

### 【表面分析研究会の活動に関わる実績】

※申請書に記載されていない特記事項を記載。たとえばセミナーや研究会での講師など。

### 【表面分析の標準化活動に関わる実績】

※RRT への参画(単なる測定データの提供など、主体的でない活動は不可)、JIS 作成など。